

北京邮电大学2006年博士研究生考试大纲304微系统 ( MEMS ) 导论 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/160/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_97\\_E4\\_BA\\_AC\\_E9\\_82\\_AE\\_E7\\_c79\\_160928.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/160/2021_2022__E5_8C_97_E4_BA_AC_E9_82_AE_E7_c79_160928.htm) 北京邮电大学2006

年博士研究生考试大纲304微系统 ( MEMS ) 导论 一、 考试要求 要求考生掌握微机电系统 ( MEMS , Micro

Electro-Mechanical System ; 或称微光机电系统 , MOEMS , 美国惯用词 ; 或称微系统 , Microsystem , 欧洲惯用词 ; 或称微机械 , Micro-Machine , 日本惯用词 ) 的基本概念与应用原理 , 并能够灵活应用 , 具有较强的分析问题和解决问题能力。

二、 考试内容 1、 微系统的工作原理 2、 微系统设计和制造的工程科学 3、 微系统设计中的工程力学 4、 微型化中的尺度效应 5、 用于MEMS和微系统的材料 6、 微系统加工和微制造基本工艺 7、 微系统设计 8、 微系统封装 三、 试卷结构 1

、 考试时间3小时，满分100分 2、 题目类型：概念题、简答题、计算题、填空题、选择题 四、 教材及主要参考书 1、

Nadim Maluf : 《An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering》 , Artech House , Boston , London , 2000

2、 Tai-Ran Hsu : 《MEMS & Microsystems: Design and Manufacture》 , McGraw-Hill Companies , 2002 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)